

像散式量測系統之光學成像機制

本院覽號

02A-980624

公告日期

智財權狀態

美國US8269157B2放棄維護、台灣(發明)I401408放棄維護

摘要

此光學成像機制搭配像散式量測系統 (ADS) 可成為一套完整之光學量測平台。此成像機制可觀察量測光點以及物體表面之微小結構間之距離關係，搭配一致動器可將ADS之量測光點對焦於物體表面上微小結構之不同區域，並量測此結構之高度角度及其變化。

技術優勢

大幅縮短像散式量測系統之雷射光點瞄準時間 提升像散式量測系統之使用方便性

應用範圍

MEMS元件製程良率檢測 光學表面輪廓儀應用 以懸臂樑為基礎之生化感測器量測應用

創作人

黃英碩、胡恩德、洪紹剛



中央研究院
ACADEMIA SINICA